不同气氛下 SiO_x 纳米线的制备及形貌、 红外、光致发光研究 *

郑立仁123 黄柏标234 尉吉勇233)

1)(泰山学院物理与电子科学系 泰安 271021) 2)(山东大学晶体材料国家重点实验室 济南 250100) 3)(山东大学化学与化工学院 济南 250100) (2008年4月7日收到 2008年8月14日收到修改稿)

以 N_2/H_2 、 N_2 或 NH_3 为载气 利用碳辅助化学气相沉积法 ,常压 1140 个下在石英衬底上制备了大量直径为 20-300 nm ,长数百微米的非晶 SiO_x 纳米线.制备得到的纳米线具有高度定向生长的特性.利用透射电子显微镜、扫描电子显微镜及电子能谱对 SiO_x 纳米线的形貌及组分进行了分析 Si 与 O 原子之比为 1:1.8.傅里叶红外吸收谱显示了非晶氧化硅的三个特征峰(482 806 和 1095 cm $^{-1}$)及 1132 cm $^{-1}$ 无序氧化硅结构的强吸收峰. SiO_x 纳米线光致发光光谱(PL)在 440 nm(2.83 eV)处具有较强的荧光峰 N_2 为载气生长的 SiO_x 纳米线峰强大四个数量级.

关键词:SiO, 纳米线,碳辅助化学气相沉积法,傅里叶红外吸收,光致发光

PACC: 2852F, 7855

1. 前 言

自 1991 年日本 NEC 公司 lijima^[1]发现准一维材料碳纳米管以来,碳纳米管及其他准一维纳米材料(如金属纳米线、Si 纳米线和 SiO_x 纳米线等)由于具有优越的机械、物理、化学性能及潜在应用而备受关注.准一维氧化硅纳米材料在光致发光、低维波导、光学器件纳米埋层连接等方面具有重要意义^[2-4],在近场光学显微镜和集成光学器件上的连接上有望得到应用.近年来,对氧化硅纳米材料的制备研究,人们做了许多工作.主要包括对氧化硅一维纳米材料的发光性能的研究^[5-12],以及应用化学气相沉积(CVD)^[13,14]、激光刻蚀^[4,14]、碳辅助法^[15-17]等不同方法制备了多种形貌、高度定向排列的 SiO_x 纳米线.

本课题组用活性碳与 SiO, 粉末为原料 ,采用水

平管式炉 ,常压 1140 $^{\circ}$ 不同载气条件下在石英衬底上制备了大量非晶 SiO_x 纳米线.

2. 实验过程

取 SiO_2 粉末与活性碳粉按一定比例混合 ,放入 玛瑙研钵中研磨 ,研磨均匀后装入石英舟. 取适量的 Al 粉和 Fe_2O_3 粉末均匀混合 ,放入石英舟内并平铺在 SiO_2 粉与活性碳粉混合物的表面. 用石英片盖在石英舟上作为衬底 ,将石英舟放入事先准备好的石英管中 ,随后放入水平高温炉中(保证石英舟处于高温区). 实验在常压 1140°C下进行 所有载气流量保持在 30—50 ml/min ,反应 2 h 完毕 ,以 30—50 ml/min 速率通 N_3 气直到高温炉内的温度降为室温.

1)以 N_2 (99.999%) , N_2/H_2 (H_2 的摩尔含量为 5.06%)分别为保护气. N_2 气流量不稳定 ,大致在

^{*} 国家重点基础研究发展计划 批准号 2007CB613302 和国家自然科学基金(批准号 50721002 ,10774091)资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail bbhuang@sdu.edu.cn

50—200 ml/min 范围内变化. 结果发现:两种方法得到的产物均为白色绒毛状; N_2 载气下,产物产量明显增加.

2)通 N_2 (99.999%)1 h 后 ,换成 NH_3 气 ,再通 1 h ,总生长时间为 2 h .相同条件下 ,通 30 min 的 N_2 气后 ,换通 1.5 h 的 NH_3 气 .

SiO_x 纳米线形貌、成分和结晶性是利用 S-4800型扫描电子显微镜 SEM), JEM-100CX [] 型透射电子显微镜 (TEM)来测试. NEXUS-670型傅里叶红外吸收谱 (FTIR)仪和 FLS-920型光致发光 (PL)光谱仪分别对 SiO_x 纳米线特征峰位及相应峰强和光致发光性质进行了研究, 样品与溴化钾按 1:10 的量均匀混

合后压片 ,测得 FTIR ;PL 的测试则是把样品直接放入测试台进行的.

3. 试验结果与讨论

3.1. 形貌、成分与结晶性分析

石英衬底下表面的白色产物可以分为两部分: 衬底四周是大量绒毛状的产物(图 1(a)—(e));衬底中间区域、对应 A1 粉和 Fe_2O_3 粉末混合物的正上方)是一层不好收集(用刀片难刮下)产量不多的膜(图 1(f)).

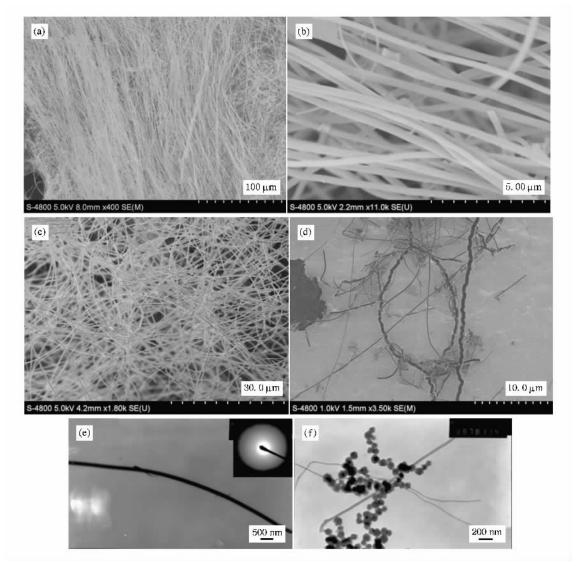


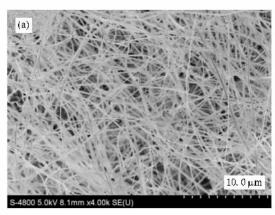
图 1 不同载气下得到的衬底四周白色绒毛产物及衬底中间白色膜的形貌照片 (a)1140 \mathbb{N}_2 载气低倍 SEM 照片 (b)1140 \mathbb{N}_2 载气高倍 SEM 照片 (c)1140 \mathbb{N}_2 载气 SEM 照片 (d)1140 \mathbb{N}_2 载气表面不光滑的 SiO_x 纳米线 SEM 照片 (e)1140 \mathbb{N}_2 载气单根 SiO_x 纳米线 TEM 照片及选区电子衍射图 (f)1140 \mathbb{N}_2 / \mathbb{N}_2 载气下衬底中间白色膜的 TEM 照片

图 1 是一组不同载气下 SiO_x 纳米线典型形貌 照片.纳米线表面光滑,直径为20-300 nm,且SiO, 纳米线具有定向生长的特性(图1(a)(b)和图2(a), (b)). 纳米线 TEM 照片(图 1(e))与 SEM 照片(图 1 (a)(b))显示的形貌特征吻合.单根纳米线选区电 子衍射图(图 1(e)右上角)显示 SiO_x 纳米线是非晶 的.与 N_2/H_2 载气下的 SiO_x 纳米线(图 1(c)) 直径 20-200 nm)相比,N2载气生长的纳米线直径变粗, 长度更长,且产物中出现了表面不光滑的 SiO。纳米 线 图 1(d)).这与 N。载气流量极不稳定有关.当载 气流量很大(150-200 ml/min)时,载气把参与SiO, 纳米线生长的中间物(SiO等)带走,此时纳米线直 径较细.而当载气流量较小(50-100 ml/min)时,参 与纳米线生长的中间物增加 此时纳米线直径较粗. 所以在 N₂ 载气流量极不稳定时 ,出现图 1(d)所示 形貌的纳米线概率更大或者在产物中发现这种形貌

的 SiO_x 纳米线量较多.图 I(f)显示的是石英衬底中间区域不好收集的白色膜的 TEM 照片 ,其中有大量 Al 粉和 Fe_2O_3 粉末的反应产物合金颗粒 ,而 SiO_x 纳米线含量很少.

图 2 是通 1 h N_2 后 ,再通 1 h NH_3 气所制备的 SiO_x 纳米线的 SEM 照片 . SEM 显示 SiO_x 纳米线直径分布和 N_2 载气下的大致相同 ,说明 SiO_x 纳米线最佳生长时间在 1 h 左右 .通 30 min N_2 ,1 .5 h NH_3 所制备的 SiO_x 纳米线直径为 100 nm 左右 ,且表面不光滑 ,其选区电子衍射图(图 3 右上角)显示是典型非晶氧化硅 .

图 4 为 1140 °C 不同载气条件制备得到 SiO_x 纳米线的成分分析 .图 4(a)的能量色散谱(EDS)显示 SiO_x 纳米线中 Si 与 O 原子数之比约为 1:1.8(34.9:64.04) 氣不足 :同时图 4(a)呈现出纳米线的长度大于 $200~\mathrm{nm}$.



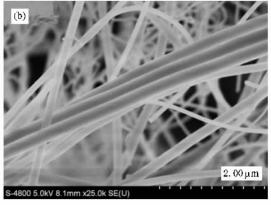


图 2 1140℃通 1 h NH; 制备的 SiO_x 纳米线 SEM 照片 (a)低倍照片 (b)高倍照片

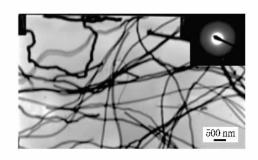


图 3 1140 ℃ 通 1.5 h NH, 制备的 SiO_x 纳米线 TEM 照片

通 1 h NH_3 气所得 SiO_x 纳米线 EDS 成分分析 (图 4(b))显示 SiO_x 纳米线中含有氮元素 A Si = 0 的原子数比为 1:1.8 ,这个结果与以 A Si = 0 一致.

3.2.FTIR 特性

图 $\mathfrak{S}(a)$ 中谱线 1 与谱线 2 几乎重合,说明 N_2 或 N_2/H_2 载气对 SiO_x 纳米线的生长影响差别不大 $.N_2$ 载气生长的 SiO_x 纳米线产量大 ,这是由于 N_2 为载气时 ,有更多的氧参与 SiO_x 纳米线生长 . 图 $\mathfrak{S}(b)$ 是石英衬底不同位置产物所对应的红外谱图 . 谱线 2 是衬底四周绒毛状产物结果 ,谱线 1 是衬底中间白色膜的测试结果 . 与谱线 2 相比 ,谱线 1 中位于 808 cm $^{-1}$ 处的峰蓝移到 818 cm $^{-1}$,这是纳米线的结晶性不同所致 ,位于 550 ,1132 cm $^{-1}$ 处的两个峰 ,强度大大减弱 ;其他的峰位及对应的强度没发生变化 . 位于 3420 ,1630 和 1390 cm $^{-1}$ 处的峰是样品所吸附水的峰 ,在 1390 cm $^{-1}$ 附近同时含有 Si -N 键的红外吸收

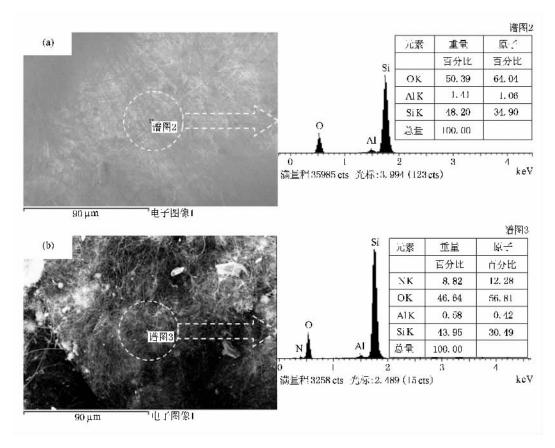


图 4 1140℃不同载气下制备的 SiO_x 纳米线成分分析 (a)2 h N₂ (b)1 h N₂/1 h NH₃

振动峰.

图 5(c) 是总生长时间为 2 h, 通 N。 气和 NH。 气 时间不同所制备的 SiO, 纳米线的红外谱, 随通 N。 气时间缩短,纳米线位于 1090 cm-1 处峰强减弱, 1090 ,1132 cm⁻¹ 双峰变成单峰 1100 cm⁻¹. 谱线 1 在 1100 cm⁻¹处峰不尖锐,应该是 1090 和 1132 cm⁻¹两 个峰形成 流谱线 2 是通 0.5 h N₂ ,1.5 h NH₃ 所制备 的 SiO_x 纳米线的红外谱 ,显然位于 1090 ,1132 cm⁻¹ 两峰的强度更弱,成一单峰位于 1121 cm⁻¹. SiO, 纳 米线的产量随通 N, 气时间缩短(通 NH, 时间增加) 而减少 这说明 NH, 的通入没有促进 SiO, 纳米线的 生长.图 3 显示纳米线的直径为 100 nm 左右,这是 在通 N_2 气时所生长的. NH, 在 1140 \mathbb{C} 分解为 N_2 与 H, ,H, 与系统中的氧结合生成水,阻止了氧参与生 长 SiO, 纳米线,于是 SiO, 纳米线停止生长.图 5 结 果还显示了 NH。载气的存在并没有在 SiO。纳米线 中引入新的价键:不过位于 1390 cm⁻¹处的峰强随通 NH、气时间的增加而明显增强,该峰是 Si—N 键的 伸缩振动, 纳米线 TEM 照片(图 3)显示 SiO, 纳米线 的表面不光滑,这是由于 NH。 气和 SiO 气体反应后

在氧化硅纳米线的表面形成了一层厚度不均匀的氮化层.同时图 f(c) 中谱线 1 在 $808~cm^{-1}$ 处的峰蓝移到 $818~cm^{-1}$ 处,谱线 2 在 $808~cm^{-1}$ 处的峰蓝移到 $812~cm^{-1}$ 处,流位于 $480~550~,1630~cm^{-1}$ 处的峰均未受到影响,位于 3420~ 和 $1390~cm^{-1}$ 处的峰强增大,

3.3.PL 特性

图 6 是不同载气下产物的 PL 谱.测试在室温下进行,激发波长为 360 nm,滤光片截至波长为 420 nm.结果表明,PL 谱的峰位在 440 nm(2.83 eV). SiO_x 纳米线中氧(Si = 0) 摩尔比为 1:1.8)不足,440 nm 峰归因于中性的氧空位(=Si-Si=)61.

图 $\mathfrak{C}(a)$ 表明 : N_2 载气和 N_2/H_2 载气下 ,衬底四周区域绒毛状白色产物的荧光效率都比衬底中间区域白色膜(不易收集)的荧光效率高. 红外图谱(图 5 (b))显示衬底中间白色膜在 $1100~\mathrm{cm}^{-1}$ 峰强减弱 ,特别是 $1132~\mathrm{cm}^{-1}$ 峰强减弱最明显. 所以 SiO_x 纳米线PL谱 $440~\mathrm{nm}$ 峰位及其强度与红外谱中的 $1090~\mathrm{cm}^{-1}$ 处 $\mathrm{Si-O}$ 非对称伸缩振动和 $1130~\mathrm{cm}^{-1}$ 处 SiO_x 纳米线 线无序结构有直接的关系. 而且 N_2 载气下 ,衬底四周绒毛状 SiO_x 纳米线的荧光效率最高(图 $\mathfrak{C}(a)$). 这

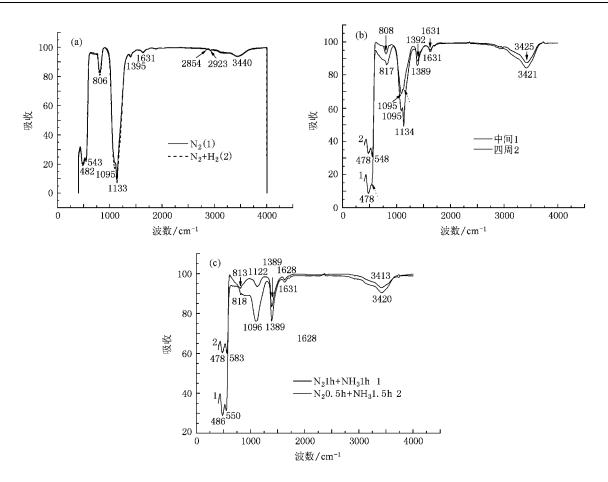


图 5 1140 $^{\circ}$ 不同载气下制备的 SiO_x 纳米线的红外吸收谱 $(a)N_2$ N_2/H_2 载气衬底四周产物 形貌见图 1 中 $(a)(c)(b)N_2$ 气衬底表面不同位置产物 形貌见图 1(a)(f)(c)1h $N_2/1h$ NH_3 0.5h $N_2/1.5h$ NH_3 衬底四周产物 形貌见图 2 图 3)

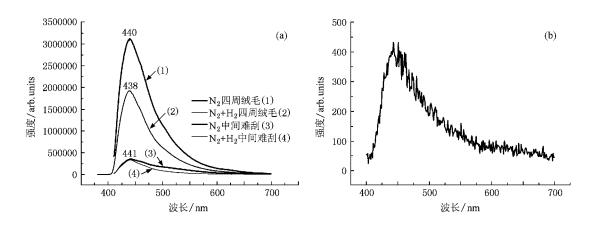


图 6 1140 $^{\circ}$ 不同载气下产物的 $^{\circ}$ $^{\circ}$

是 N_2 气条件下纳米线的直径变粗及产量增大所造成的.通 $1 \text{ h } N_2$ $1 \text{ h } NH_3$ 所制备纳米线 PL 谱(图 6 (b))显示:其峰强比 N_2 气下 SiO_x 纳米线的约小四个数量级(图 O(a)),几乎没有荧光效应;谱图峰位(440 O(a)),没有发生变化,谱线上的许多小峰是测试

过程中噪声所致. 因此 NH_3 的通入对 SiO_x 纳米线 生长影响很大 不利于纳米线的生长.

4. 结 论

利用碳辅助 CVD 方法 ,常压 1140℃温度下在石

英衬底上制备了大量直径为 20—300 nm 非晶 SiO_x 纳米线. 研究了在不同的载气(N_2 , N_2/H_2 , NH_3)下 SiO_x 纳米线的生长情况. N_2 载气下 , SiO_x 纳米线产量最大 ,且其直径和长度有所增加 ;而 NH_3 气不利于纳米线的生长 . 衬底不同位置产物的 TEM 显示:衬底中间的白色膜中有大量的 Al 粉和 Fe_2O_3 粉末

的反应产物合金 $_{,SiO_{x}}$ 纳米线含量少 ;四周绒毛是大量高纯且具有高度定向生长特性的非晶 $_{SiO_{x}}$ 纳米线 .PL 谱显示绒毛状 $_{SiO_{x}}$ 纳米线荧光效率很高 ,比通 $_{NH_{3}}$ 气后生长 $_{SiO_{x}}$ 纳米线荧光效率大四个数量级 ,PL 峰位在 $_{440}$ nm 左右 ; $_{N_{2}}$ 载气下 $_{SiO_{x}}$ 纳米线的 $_{PL}$ 谱峰强最大 .

- [1] Iijima S 1991 Nature **354** 56
- [2] Wang Y W , Liang C H , Meng G W , Peng X S , Zhang L D 2002 J. Mater . Chem . 12 651
- [3] Li S H , Zhu X F , Zhao Y P 2004 J. Phys. Chem. B 108 17032
- [4] Yu D P , Hang Q L , Ding Y , Zhang H Z , Bai Z G , Wang J J , Zou Y H , Qin W , Xiong G C , Feng S Q 1998 Appl . Phys . Lett . 73 3076
- [5] Skuja L, Tanimura K, Itoh N 1996 J. Appl. Phys. 80 3518
- [6] Nishikawa H , Shiroyama T , Nakamura R , Ohki Y , Nagasawa K , Hama Y 1992 Phys . Rev . B 45 586
- [7] Liao L S , Bao X M , Zheng X Q , Li N S , Min N B 1996 Appl .
 Phys . Lett . 68 850
- [8] Wang N, Tang Y H, Zhang Y F, Lee C S, Bello I, Lee S T 1999

 Chem. Phys. Lett. 299 237
- [9] Peng X S , Wang X F , Zhang L D 2002 Appl . Phys . A 74 831
- [10] Xia Z Y , Han P G , Wei D Y , Chen D Y , Xu J , Ma Z Y , Huang X F , Chen K J 2007 Acta Phys . Sin . 56 6691 (in Chinese) [夏

正月、韩培高、韦德远、陈德媛、徐 骏、马忠元、黄信凡、陈坤基 2007 物理学报 **56** 6691]

- [11] Yu W, Li Y C, Ding W G, Zhang J Y, Yang Y B, Fu G S 2008

 Acta Phys. Sin. 57 3661(in Chinese) [于 威、李亚超、丁文革、张江勇、杨彦斌、傅广生 2008 物理学报 57 3661]
- [12] Pan Z W , Dai Z R , Ma C , Wang Z L 2002 J. Am. Chem. Soc. 124 1817
- [13] Ma R Z , Bnado Y 2003 Chem . Phys . Lett . 377 177
- [14] Wang J C , Zhan C Z , Li F G 2003 Solid . State . Commun . 125 629
- [15] Wenger K S , Cornu D , Chassagneux F , Epicier T , Miele P 2003 J. Mater . Chem . 13 3058
- [16] Wu X C , Song W H , Wang K Y , Hu T Zhao B , Sun Y P , Du J J 2001 Chem . Phys . Lett . 336 53
- [17] Zhu Y Q , Hsu W K , Terrones M , Grobert N , Terrones H , Hare J P , Kroto H W , Walton D R M 1998 J . Mater . Chem . 8 1859

Preparation of SiO_x nanowires in different atmosphere, their morphology, PL and FTIR properties

Zheng Li-Ren^{1 (2)} Huang Bai-Biao^{2)†} Wei Ji-Yong^{2 (3)}
1)(Department of Physics and Electronics , Taishan University , Tai 'an 271021 ,China)
2)(State Key Laboralory of Crystal Materials , Shandong University , Jinan 250100 , China)
3)(School of Chemistry and Chemical Engineering , Shandong University , Jinan 250100 , China)
(Received 7 April 2008 ; revised manuscript received 14 August 2008)

Abstract

High-density SiO_x nanowires were fabricated on a large-scale using carbon-assisted CVD method by Fe—Al—O catalyst at 1140°C in flowing N_2/H_2 , N_2 and NH_3 atmospheres. The SiO_x nanowires have uniform diameters of 20—300 nm and lengths of up to a few hundred micrometers. SEM , TEM , EDS , FTIR and PL were preformed to characterize the microstructure , composition and optical performance of the nanowires. Energy dispersive X-ray spectral analysis reveals that the nanowires consist of Si and O elements in an atomic ratio of approximately 1:1.8. The nanowires show IR absorption peaks at 482 806 ,1095 and 1132 cm⁻¹. The PL peak of the nanowires is located at 440 nm(2.83eV). The PL inensity of the SiO_x nanowire(N_2/NH_3).

 $\textbf{Keywords}: SiO_x$ nanowire , carbon-assisted CVD method , FTIR spectrum , PL spectrum

PACC: 2852F, 7855

^{*} Project supported by the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2007CB613302) and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 51721002, 10774091).

[†] Corresponding author. E-mail bbhuang@sdu.edu.cn